RADICAL PLASMA SOURCE (REMOTE PLASMA SOURCE) - MA2000C-863BB

Categories: Composants plasma

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez	Source plasma à radicaux (Remote plasma Source)
Processus	Gravure et Dépôt (Revêtement)
Type de connexion de sortie	
Matériau Diélectrique	Saphir
Tension d\'alimentation Nominal [V]	230 / 208
Puissance de sortie [W]	2000
Fréquence [MHz]	2450

Muegge GmbH
Hochstrasse 4-6
64385 Reichelsheim
Germany

T. +49 (0)6164-9307-0
F. +49 (0)6164-9307-93
E. info@muegge.de
www.muegge.de